研修ご担当者様

令和8年度 X線光電子分光の基礎セミナー

主催：(公財)福島県産業振興センター　　共催：福島県ハイテクプラザ

講師からのコメント

金属、高分子材料や表面処理、多層膜の試料等に対し、最表面の分析が可能なX線光電子分光法(XPS)について解説します。本装置を活用することで、電子顕微鏡では見逃す極薄の被膜や汚れの検出、表面官能基の確認や金属酸化物の価数判別、ナノ多層膜の膜厚測定などが行えます。

本セミナーでは測定原理から組成、化学状態解析について説明し、深さ方向分析による応用事例なども紹介します。また、XPSの実演では、サンプリングから測定の様子をご覧いただけます。

■内　　容　1.座学（基礎編）　・XPSとは？ 原理の紹介
　　2.座学（応用編）　・深さ方向分析の分析事例の紹介

■講　　師　日本エフイー・アイ株式会社
　　齋藤 健 氏

■日　　時　**令和8年7月2日(木) 13時30分～16時30分**

■場　　所　福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 （郡山市待池台1-12）

■受 講 料　**無料**

■定　　員　15名

■申込締切　**令和8年6月18日(木)**　**※定員になり次第締め切ります。**

■申込方法　申込書の**太枠内を全て**ご記入の上、E-mail又はFAXでお申し込みください。
（受講が承認された方には、締切後、受講決定通知書をメールで送付いたします。）

■申込問合先　(公財)福島県産業振興センター 技術支援部 セミナー事務局
TEL:024-959-1929　**FAX:024-959-1889**
E-mail: seminar@f-open.or.jp

令和8年度 「X線光電子分光の基礎セミナー」 申込書

会社名			
業　種		主要製品	
住　所	〒		
TEL		FAX	
ふりがな 受講者名		部署名	
ふりがな 受講者名		部署名	
事務連絡担当者名		部署名	
E-mail			

＊ご記入いただいた情報は、当センター実施事業に使用させていただく場合がありますのでご了承ください。